RayZher

銳澤實業股份有限公司

股票代號 7703

2026年11月20日

免責聲明

本簡報資料所提供之資訊，包含所有前瞻性的看法，將不會因任何新的資訊、未來事件、或任何狀況的產生而更新相關資訊。

銳澤實業股份有限公司（本公司）並不負有更新或修正本簡報資料內容之責任。本簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性、完整性、或可靠性，亦不代表本公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述。



大綱 Agenda

- 公司簡介
- 經營實績
- 研發概況
- 未來發展
- 公司治理

公司簡介

RayZher 銳澤實業股份有限公司

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商

基本資料

- 創立日期：民國96年11月20日
- 資本額：347,450仟元
- 112年實收資本額：347,450仟元
- 董事長：梁進利
- 員工人數：350人
- 上櫃（股票代碼：7703)
- 公司網址： https://www.rayzher.com.tw

服務產品

高科技產業用

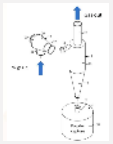
- 氣體管路工程(含主系統及二次配)
- 氣體供應系統整合工程
- 氣體供應系統設備製造及銷售





領導廠商優勢 1

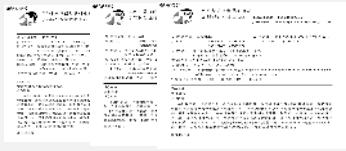
自主掌握研發趨勢



綠色創新產品
工業用粉
塵終結器

掌握技術能量

10年近30項專利





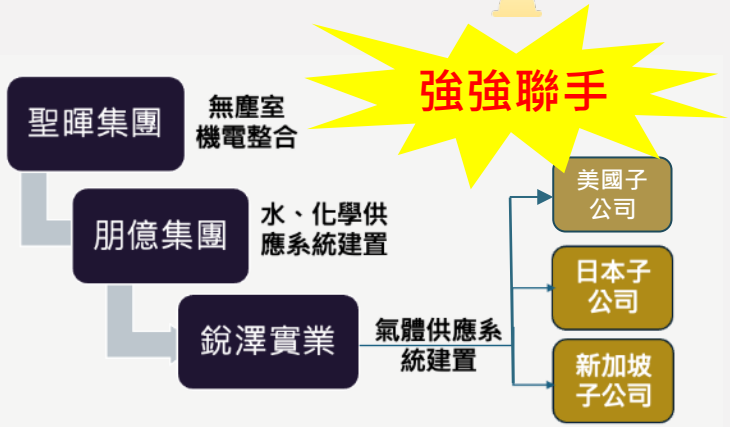
TSMC/美光 多年傑出品質管理廠商



國內大廠重要供應鏈

半導體、石化、面板

領導廠商優勢 2



集團艦隊合作 互益互補
提供高科技產業建廠一條龍服務
深耕台灣 佈局海外

RayZher
銳澤實業股份有限公司

公司沿革

發展期

2007~2013

- 創立公司，實收資本20,000仟元
- 3年後即獲利
- 強化品質認證，5年內取得SIO9001、OHSA18000認證





成長期

2014~2020

- 獲市場肯定，成為國內大廠穩固供應鏈。
- 10年內，公司規模成長10倍。
- 產官合作研發新產品，鞏固專利護城河。



擴張期

2021~2026

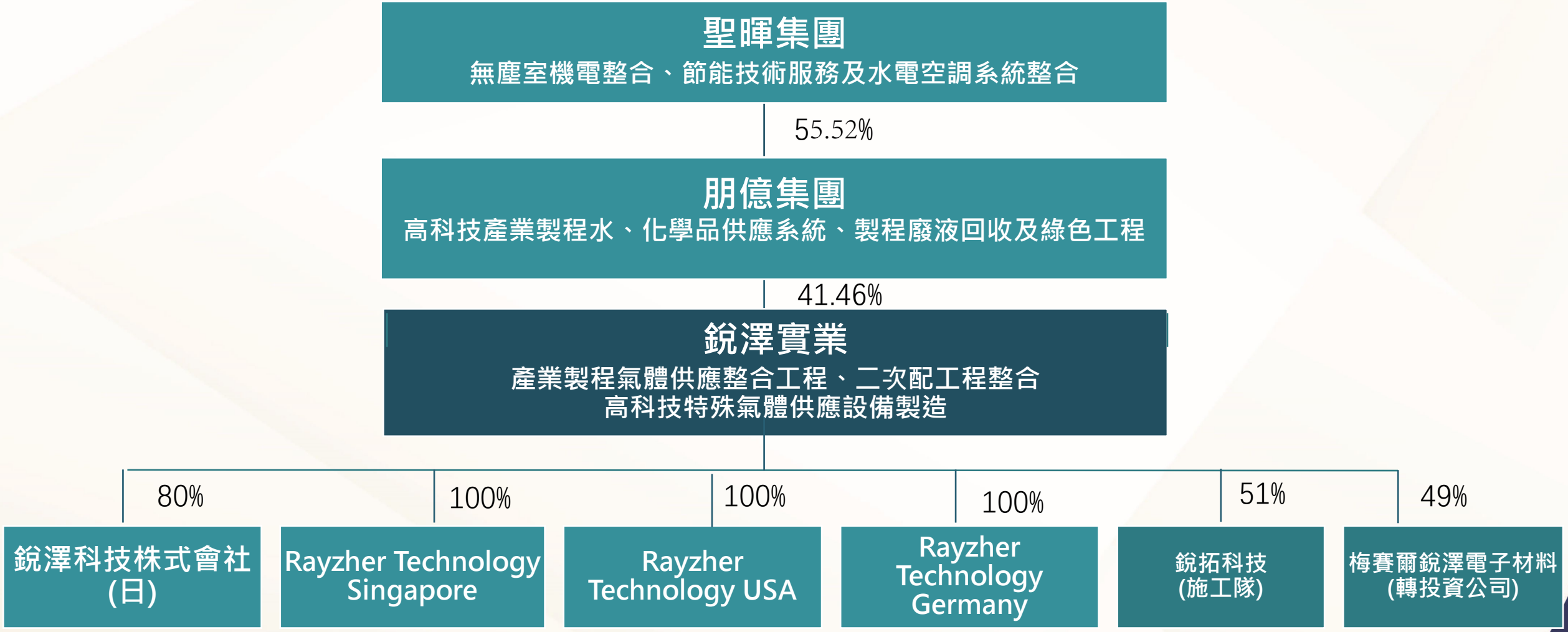
- 2021年 朋億入股，正式加入聖暉集團。
- 2022年 營收突破20億目標，創歷史新高。
- 2024年 上櫃掛牌(7703)；設置日本、新加坡子公司。
- 2025年 設置美國亞利桑那洲據點
- 2026年 德國據點、美國愛達荷州據點設置、施工隊設置

國際化

未來



集團投資架構



- 梅賽爾銳澤主係雙方合資之子公司，主要股權與經營權為梅賽爾，不併入銳澤合併財報。
  合資公司則將聚焦於電子級特種氣體與材料供應，協助銳澤從傳統系統建置向高附加價值的營運管理與特氣材料領域邁進

Complementary Partners
Forming JV to Serve the Electronics Market in Taiwan

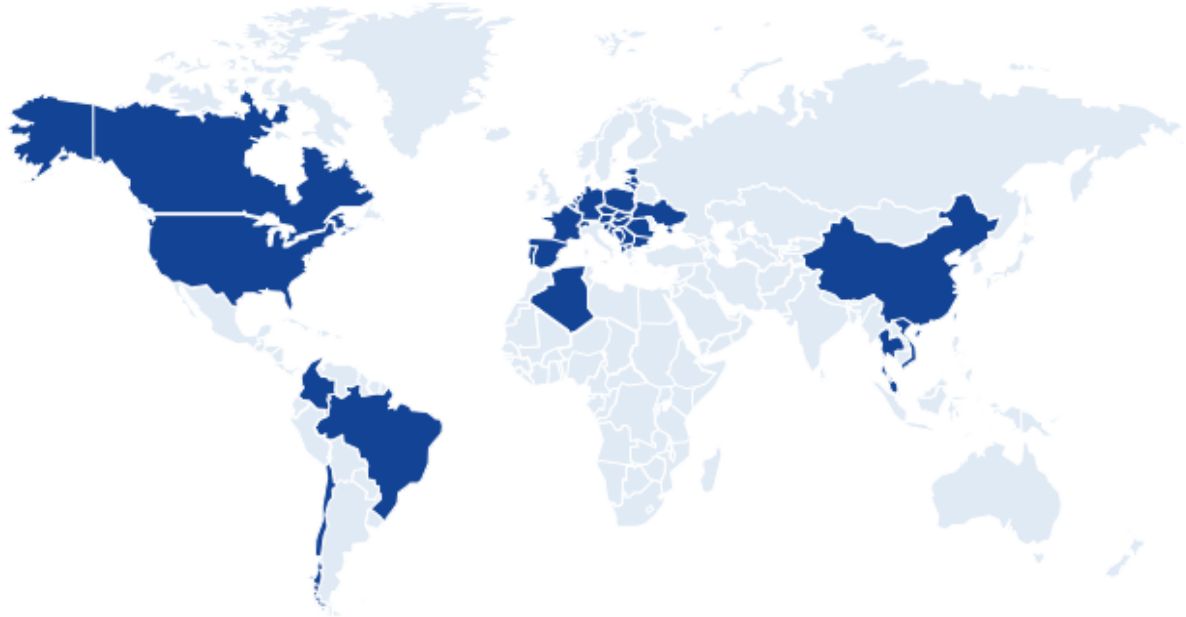
MESSER Gases for Life

About Rayzher

- Gases Engineering and infrastructure company specializing in the safe and highly reliable installation of sub-fab and facility systems for semiconductor manufacturing environments (專注在地化服務，具備最高安全與可靠性實績)
- Founded in 2007, HQ in Zhubei, Taiwan (創立於 2007 年，總部位於台灣竹北)
- 300+ Employees with 10+ locations in Taiwan (全台逾 300 名專業員工，駐點各大科學園區提供即時服務)



About Messer



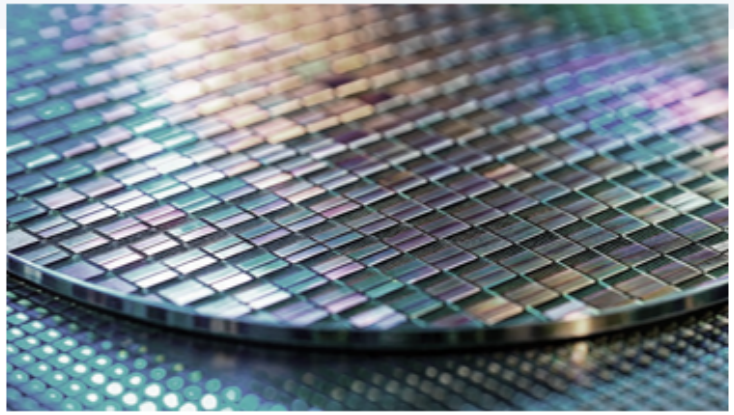
- Largest privately owned Industrial Gases company in the world (全球最大私營氣體公司)
- Global leader in the safe and high reliable supply of gases to the Electronics Industry (semiconductor) (半導體電子氣體供應全球領導者)
- Founded in 1898, HQ in Bad-Soden, Germany (創立於1898年，總部位於德國巴特索登)
- Established in 30+ countries worldwide with products produced in 20+ of those countries (業務遍及全球30餘國)

Next Steps –
Messer Electronics Taiwan Co. Ltd. (梅塞爾銳澤電子材料股份有限公司)

Inauguration: JV between Rayzher and Messer to form on November 19, 2026 (2026 年 11 月 19 日正式成立合資公司)

Commercialization: Actively offer Messer products to serve the needs of Taiwan Electronics (積極導入梅塞爾全系列產品，滿足台灣半導體與電子需求)







Localization: Plan/Develop/Implement localization strategy to best serve the market (規劃並落實在地化供應策略，提供台灣市場最佳服務)

Messer – Rayzher Joint Venture

Uniting Global Specialty Materials leadership with Taiwan's Premier semiconductor Gases Engineering expertise



MESSER Group

- **Operational Excellence:** Safe Supply/High Reliability (穩定供應與高可靠性)
- **Products:** Supply of Key Electronics Specialty Materials to serve the market (供應半導體關鍵電子特用材料)
- **Purity:** Delivering UHP products (6N/7N) (提供 6N / 7N 超高純度氣體產品)
- **R&D:** Focused to develop new solutions to solve customer challenges (專注創新研發，解決客戶製程挑戰)



RAYZHER Industrial

- **Customer:** Understanding of the Customer Priorities in Taiwan Market (精準掌握台灣半導體客戶核心需求)
- **Operational Excellence:** Safe Implementation inside the customer facility (具備客戶廠區內高安全規格的導入實績)
- **Infrastructure:** Capable to handle Electronics Specialty Materials in Taiwan Market (具備台灣市場電子特用材料的完善處理與供應能力)

Overseas locations

RAYZHER GLOBAL PRESENCE



主要業務

■高科技產業用氣體供應系統整合工程

■高科技產業二次配統包工程

■高科技產業用氣體管路工程(含主系統及二次配)

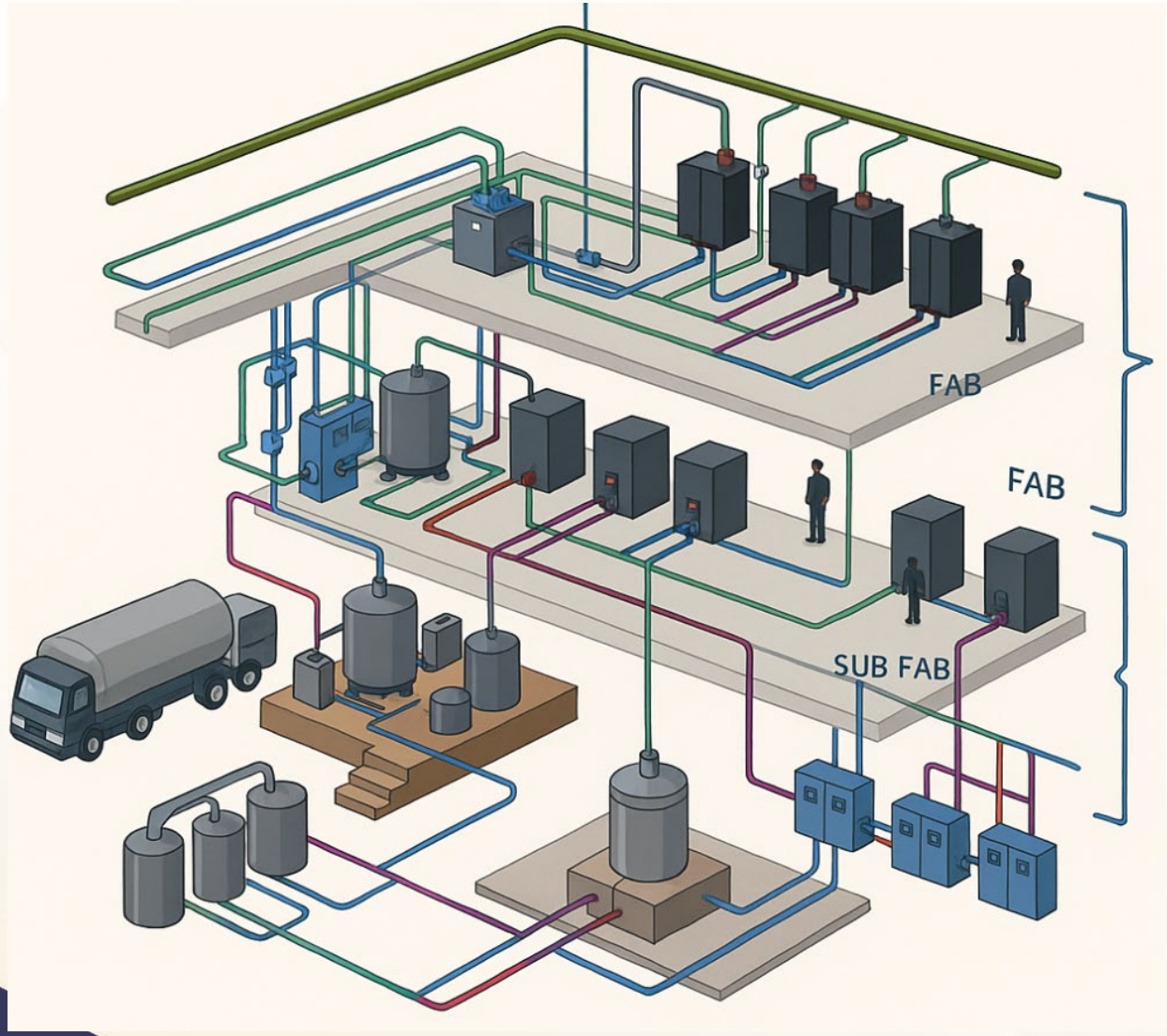
- ✓氣體主系統工程之設計、規劃與施工
- ✓設備裝機氣體二次配工程之設計、規劃與施工
- ✓全廠設備二次配統包工程之套圖、設計流程導入管理與施工

■高科技產業用氣體供應系統設備製造及銷售

- ✓氣體分流閥箱(VMB)、氣體分流盤(VMP)之設計、製造
- ✓氣瓶櫃(Cylinder CABINET)、氣瓶架(Cylinder RACK)之設計、製造
- ✓廢氣處理器(SCRUBBER) PM2.5微米粉塵捕捉裝置

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商

Sub-main Systems and Hook-up



Hook-up

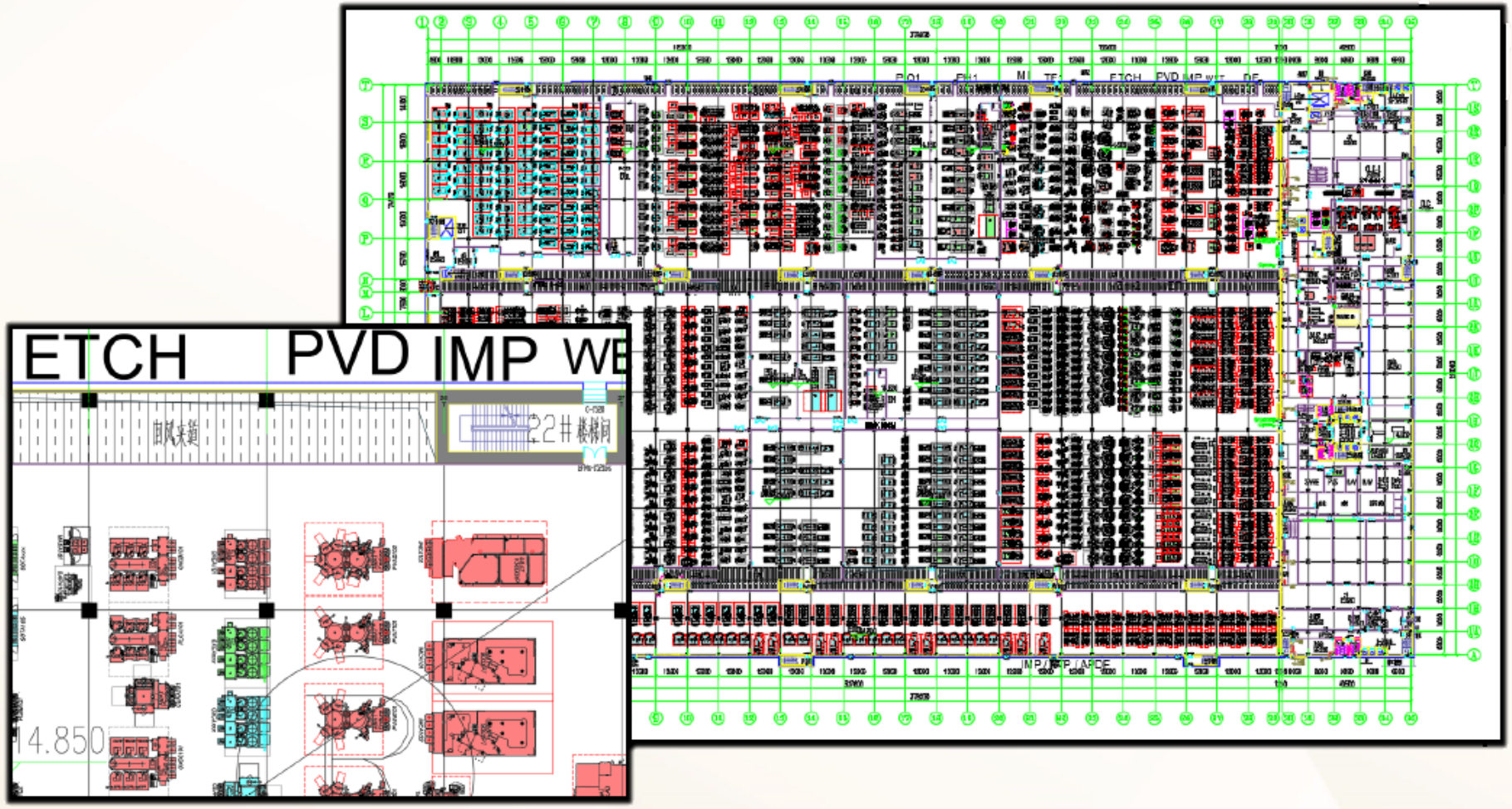
Piping systems for connecting plant equipment to process equipment.

Sub-main systems

Installation and expansion of plant systems, including gas supply equipment like GC, VMB, and purification gas systems.

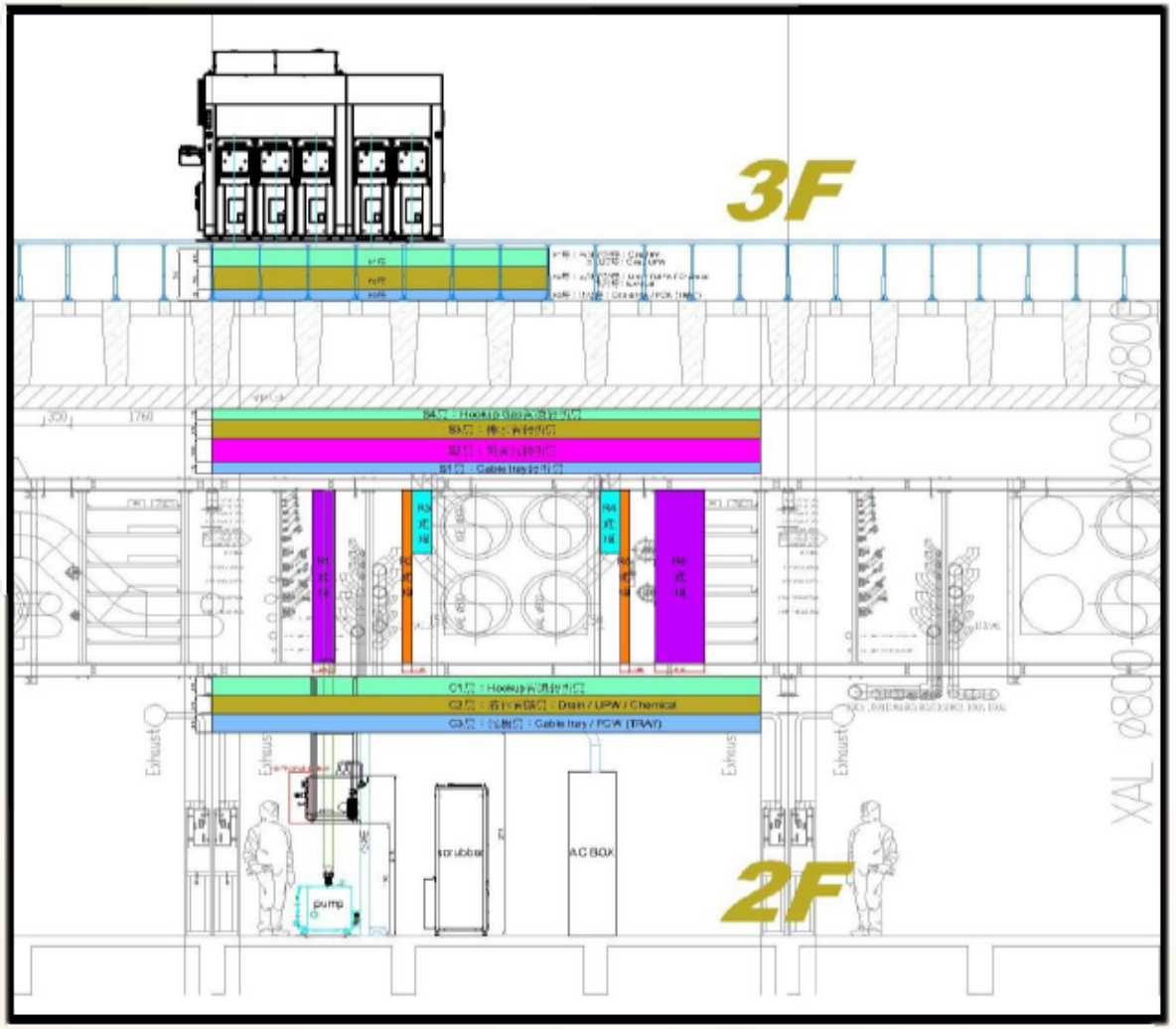
Tools Layout IE 設計

依業主要求，對整個FAB進行分區，並初步設計Tool-layout 和 Sub Tool-layout。



二次配工程介紹

半導體廠區示意圖



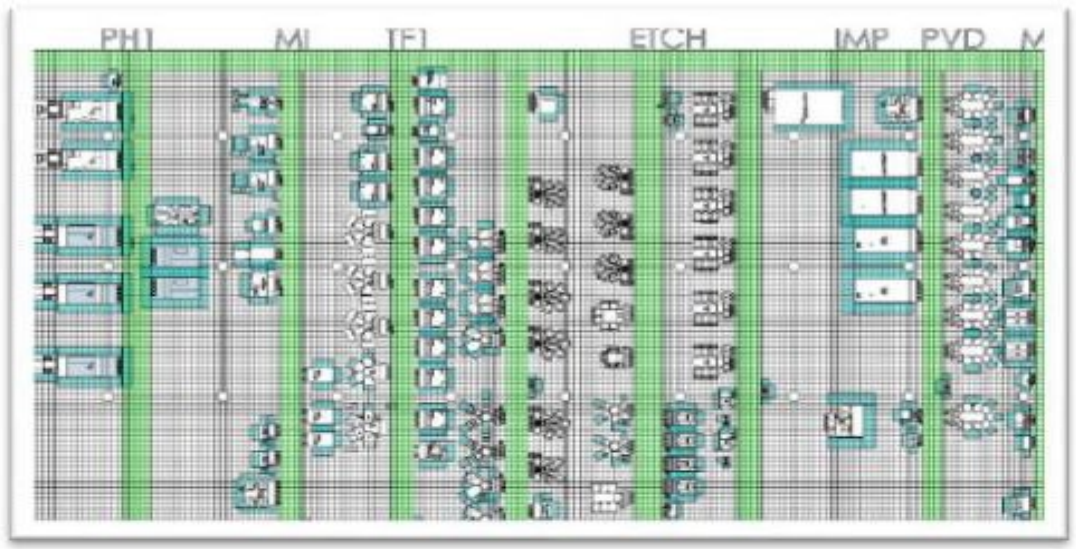
Hook up 種類：

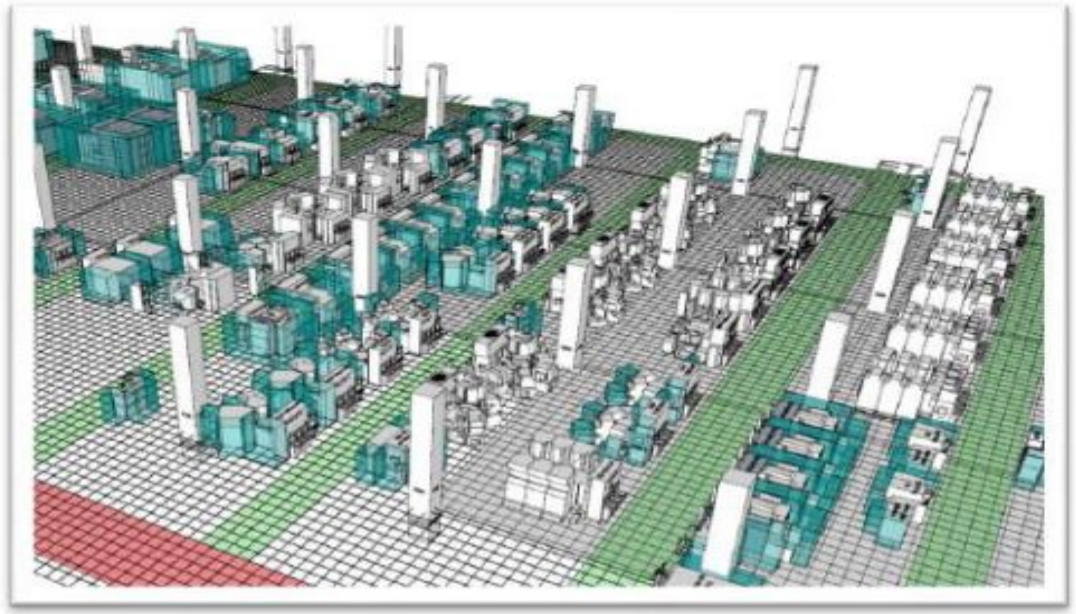
- Power 電力 hook up
- PCW 製程冷卻水 hook up
- Bulk gas 一般氣體 hook up
- Exhaust 製程排氣 hook up
- Pump vacuum pump 真空管 hook up
- Drain 製程排水 hook up
- UPW 製程超純水 hook up
- Chemical 化學品 hook up
- Special gas 特殊氣體 hook up
- Detector 氣體偵測器 hook up
- Piping rack 二樓機台 hook up 用管架（操作盤位置）
- Tool foundation 設備基座

Sub-main/Hook up 管路空間協調

施工規劃需考慮各供應系統空間需求及分配，並同時考慮施工空間及管路路徑。







設備製造與銷售

氣瓶櫃
Gas Cabinet





閥門箱/閥門盤
VMB/ VMP





氣體控制箱
Gas Box







電控箱
Valve Distributing Box





Award





Taiwan FINI100









經營實績

重要客戶

半導體製造業

tsmc
Micron
力積電
NANYA 南亞科技
TASC
VIS 世界先進
FST
台塑勝高科技 FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATION
winbond 華邦電子

石化工業

LCY 李長榮化工 LCY CHEMICAL
東横化学
THE LINDE GROUP

設備材料/系統商

Lam RESEARCH
Entegris
TEL TOKYO ELECTRON
KLA
MEC
tpc
exyte
APPLIED MATERIALS
晃瀧科技股份有限公司 Liangyih Tech Industrial Co., Ltd.
漢民 Hermes Epitek
Swift
AccuDEVICE 寶璣系統股份有限公司

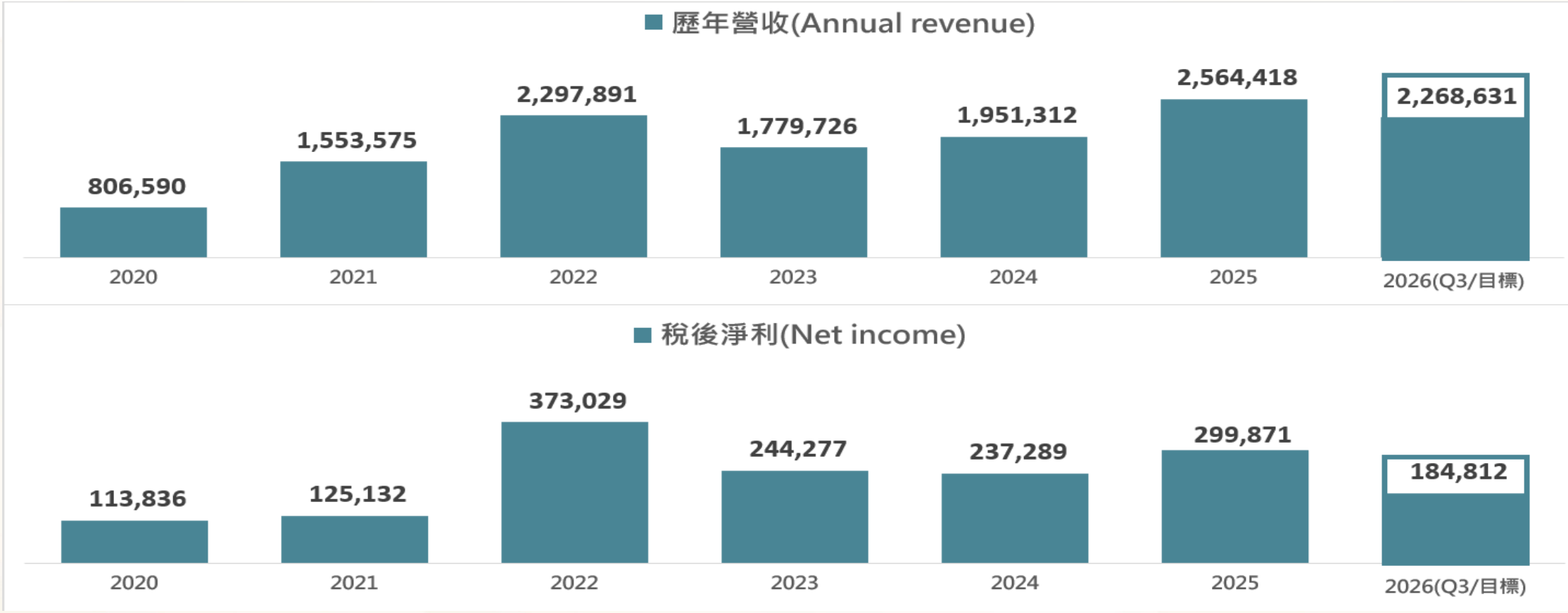
氣體公司

Air Liquide creative oxygen
大陽日酸 The Gas Professionals
AIR PRODUCTS
UIGC 聯亞科技

面板業/電芯

HannStar 瀚宇彩晶
FOXCONN 鴻海科技集團

財務績效



- 2026年加速人力擴張與全球布局，日本、美國第三季末開始有營收挹注。
- 海外子公司加速擴張及布局(美國愛達荷州)、台灣人力持續增備、今年海外營運費用預計較去年數倍增加，今年海外預計會燒1.5億。
- 半導體廠務擴充需求旺盛，看好未來中長期市場持續成長，目前在手訂單過40億。

股利發放

年份	2021	2022	2023	2024	2025
EPS(元)	6.62	17.76	9.08	7.41	8.72
股利分配(元)	5	13	7	5.5	7
分配率	76%	73%	77%	74%	80%

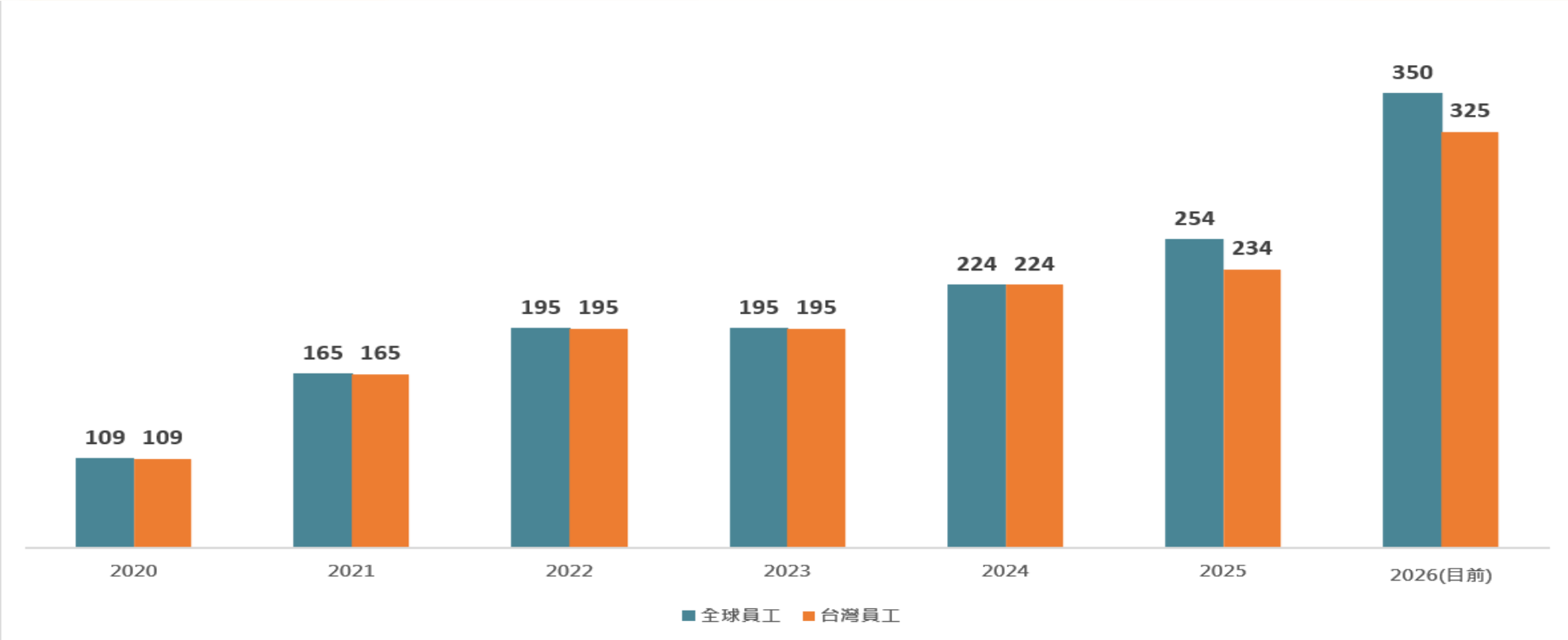
註：歷年股利發放政策皆在70%以上。

主要收入樣態

業務樣態		高科技產業用氣體/特殊氣體製供應系統及管路工程			廠務設備及材料銷售
		主系統工程	二次配工程	小型維護工程	
		新建、擴廠/產之廠務氣體供應系統工程、TurnKey	連結製程設備之二次配管工程包含氣體輸送安裝與測試	非計劃性製程設備拆、裝機配管工程	廠務設備、零件及材料之銷售業務
營收占比	2022年	29%	48%	11%	12%
	2023年	46%	39%	14%	1%
	2024年	37%	46%	15%	2%
	2025年	28%	52%	18%	3%
	2026Q3	28%	47%	23%	3%

- 主系統與二次配業務皆有成長，主系統持續挹注營收，惟目前缺料因素導致工進遞延。
- 台灣主系統及二次配案件需求持續旺盛，近期在手訂單逾40億

歷年員工人數及人均營收



- 因應公司規模成長，員工人數持續提升，2026年全球員工人數350位，人力已增加逾40%，全球持續增聘人力。
- 目標全球人力超過400人

研發概況

RayZher 銳澤實業股份有限公司

粉塵捕捉裝置(PCD)

股票代號 7703

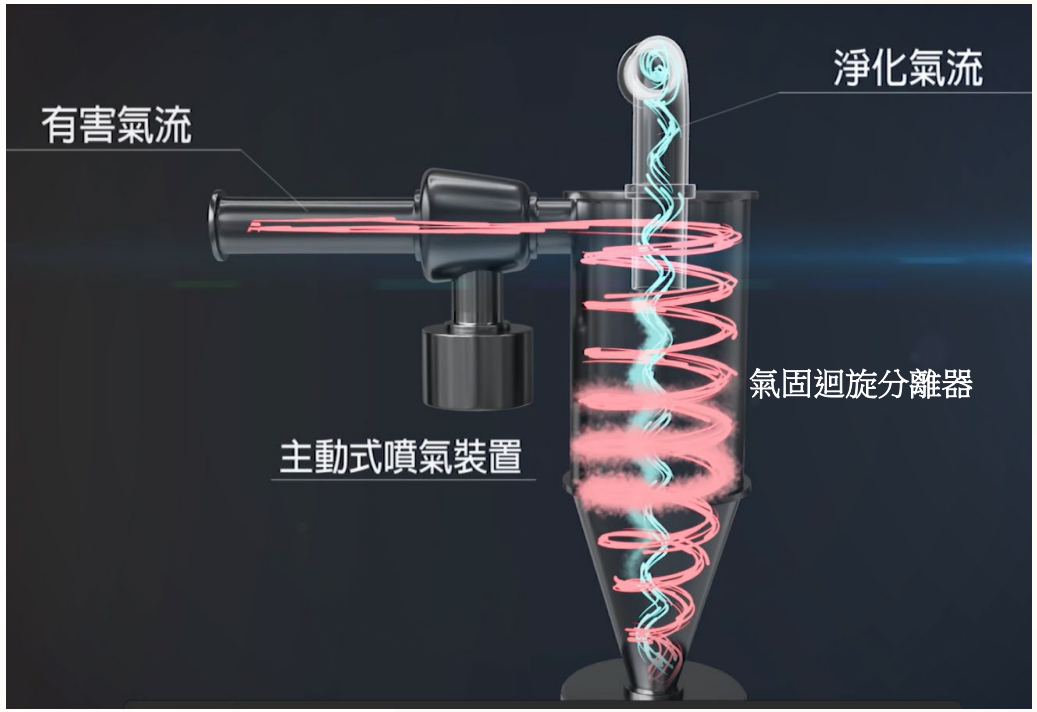
新型除塵設備 Powder Capture Device

產業問題

- SubFab端**管道粉塵堵塞**造成設備無預警當機，影響Fab端製程良率
- 目前粉塵捕捉技術多為**灑水式設計**，利用小水滴潤溼粉塵結塊後以重力往下排出，對於大顆粒粉塵去除效果不錯，但對先進製程需要**去除PM2.5以下的粉塵去除效率不佳**



技術解決方案



利用**主動式氣旋**分離粉塵避免堆積在管壁中，解決半導體產業之粉塵堵塞問題，降低設備停機PM時間

技術特點

- 高效率捕捉粉塵，1μm以上粉塵捕捉率達90%以上
- **無水化捕捉**之粉塵仍為乾燥，無後續廢水處理問題
- 提升後續Burn Scrubber**燃燒特氣效率**，延長設備壽命。
- 設備具備**體積小、能耗低**

獲證專利

- ✓ 台灣發明專利（集塵裝置）I880753
- ✓ 台灣新型專利（噴氣模組以及主動式噴氣系統）M664366

目前美光廠內認證中，預計年底前會有認證結果

RayZher 銳澤實業股份有限公司

新型除塵設備

肘管集塵裝置(AFM+ECD)

股票代號 7703

產業問題

- 在SubFab端 Dry pump出口端管道連接**肘管處，最容易發生粉塵堆積**，造成 pump 無預警當機，影響Fab端製程良率
- 目前針對90度 肘管多半需**包覆加熱帶**避免粉塵堆積，並需要定時停機清潔管道粉塵

技術特點

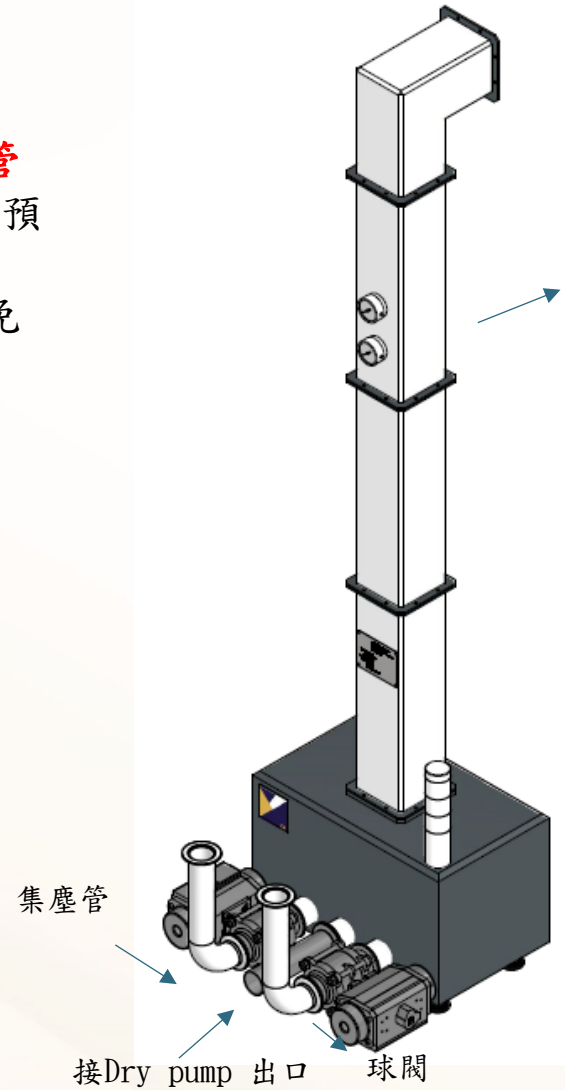
- ✓ 位移式更換管件，可火線作業不需停機
- ✓ 機械力清理肘管粉塵不需使用水及氣
- ✓ 集塵管易於更換，也不需停機

獲證專利

台灣新型專利

- ✓ 管件集塵裝置（M672380）
- ✓ 導流模組以及供氣裝置（M672387）

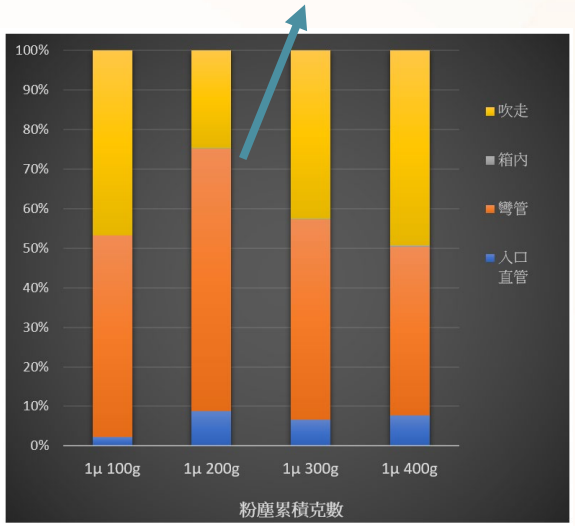
技術解決方案



解決肘管處易堆積問題



每堆積100g移動一次管件，彎管處集塵效果約40%~60%



新型設計安裝於dry pump 出口處，利用**換管機制**兼具集塵與清潔功能，大幅降低清管需要時間，可火線作業不需停機

目前美光廠內認證中，預計年底前會有認證結果

敬請指教

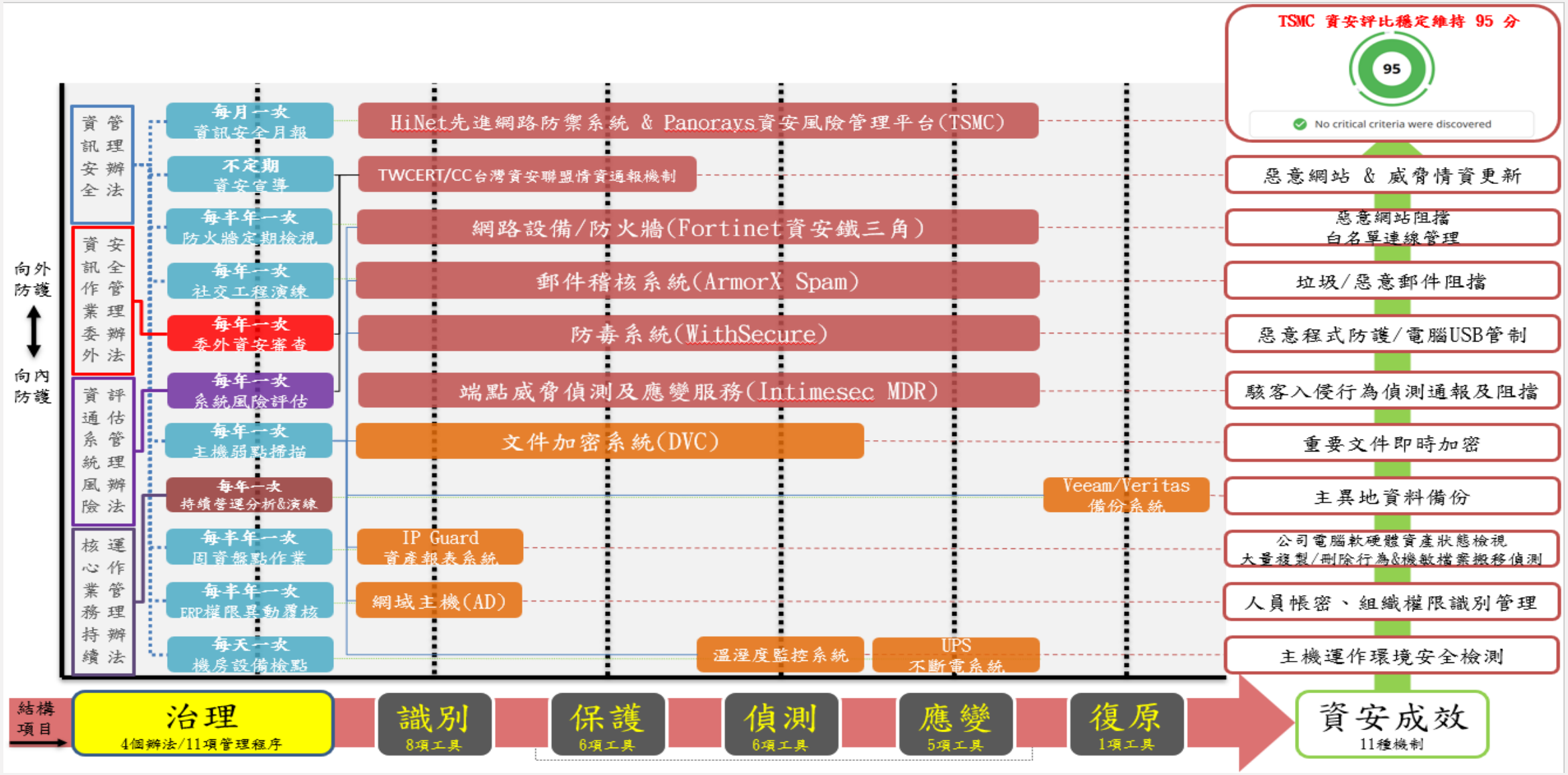
環境，共好；社會，同行；治理，創新

ESG報告編制狀況說明

- 以符合GRI、SASB、TCFD準則來進行編制
- 永續報告書榮獲2025年第十八屆TCSA台灣企業永續獎：服務業-第2類銅級獎
- 永續報告書榮獲2025年第二屆成功永續金質獎
- 預計2026年度進行永續報告認證
- 爭取進入公司治理前10%
- 2026年完成IFRS永續揭露準則導入，股東會年報揭露

RayZher
銳澤實業股份有限公司

資安結構完整度



銳澤高度重視資安，每年定期接受業主安排第三方資安認證，皆取得極高資安評價。